

# Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0125U001384

Відкрита

Дата реєстрації: 27-02-2025

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



## 1. Загальні відомості

**Підстава для проведення робіт:** 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

**КПКВК:**

**Напрямок фінансування:** 2.2 - прикладні дослідження і розробки

### Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

**Загальний обсяг фінансування (тис. грн.):** 0.000

**У тому числі по роках (тис. грн.):**

Рік	Фінансування
-----	--------------

## 2. Замовник

**Назва організації:** Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

**Код ЄДРПОУ/ІПН:** 02070921

**Адреса:** проспект Берестейський, буд. 37, м. Київ, 03056, Україна

**Підпорядкованість:** Міністерство освіти і науки України

**Телефон:** 380442367989

**Телефон:** 380442044862

**Телефон:** 380442049494

**E-mail:** mail@kpi.ua

**WWW:** <https://kpi.ua/>

### 3. Виконавець

**Назва організації:** Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

**Код ЄДРПОУ/ПН:** 02070921

**Підпорядкованість:** Міністерство освіти і науки України

**Адреса:** проспект Берестейський, буд. 37, м. Київ, 03056, Україна

**Телефон:** 380442367989

**Телефон:** 380442044862

**Телефон:** 380442049494

**E-mail:** mail@kpi.ua

**WWW:** <https://kpi.ua/>

### 4. Співвиконавець

### 5. Науково-технічна робота

#### Назва роботи (укр)

Експериментальні методи оптичної пірометрії з компенсацією випромінювання та дефлектометрії для вимірювання параметрів епітаксійних напівпровідникових шарів

#### Назва роботи (англ)

Experimental methods of optical pyrometry with emissivity compensation and deflectometry for measuring parameters of epitaxial semiconductor layers

#### Мета роботи (укр)

Дослідження та розробка оптоелектронних систем реєстрації пірометра та дефлектометра для вимірювання параметрів напівпровідникових шарів в процесі епітаксійного росту

#### Мета роботи (англ)

Research and development of optoelectronic pyrometer and deflectometer registration systems for measuring parameters of semiconductor layers during epitaxial growth

#### Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:** Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій

**Вид роботи:** 48 - прикладна

**Очікувані результати:** Вироби технічні, Методи, теорії, Методичні документи

**Галузь застосування:** Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

### 6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	01.2025	12.2025	Проміжний звіт	Розроблення оптоелектронного модуля пірометра-рефлектометра. Розроблення позиційно-чутливого фотоприймального модуля
2	01.2026	12.2026	Проміжний звіт	Розроблення програмно-апаратного комплексу для діагностики оптоелектронних компонент
3	01.2027	12.2027	Остаточний звіт	Розроблення системи реєстрації ультрафіолетового випромінювання

## 7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 47.13.11, 47.33.33, 47.09.29, 59.41.33, 90.27.37

Індекс УДК: 621.38.049.77.002; 621.375.82.002, 621.38.049.77, 621.315.592, 681.7.08:535.232, 535.08; 681.7.08

## 8. Заключні відомості

### Керівник організації:

Мельниченко Анатолій Анатолійович (д.філос.н.)

### Керівники роботи:

Воронько Андрій Олександрович (к.т.н.)

Відповідальний за подання документів: Воронько Андрій Олександрович (Тел.: +38 (097) 473-93-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності  
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.